

こんにちは。学部3年の沼尾 直毅と申します。花粉のつらい時期が今年もやってきましたね。私は毎年花粉にひどく困らされておりますので、杉さんにはもう少し遠慮してもらいたいものです。

さて、本題に移りたいと思います。私はこの1年間アドバンス創造工学研修で須川・黒田研究室に配属され、研究を行ってきました。そこで、その研究成果を先日立教大学で行われたサイエンス・インカレという研究発表会で発表しました。私は「見えないガスを撮影！～紫外吸光イメージングによる半導体製造装置内ガス濃度分布計測」という題で口頭発表をしたのですが、光栄なことに、企業・団体賞の1つである「東京エレクトロン賞」を受賞することができました。東京エレクトロンさんは半導体製造における大手企業であり、今回の発表内容から最も発表を見て頂きたい企業でしたので、研究が評価されたことを非常にうれしく思っております。

私は昨年もサイエンス・インカレに参加したのですが、そのときは賞をとることができず悔しい思いをしました。そのときから私は「来年は必ず賞をとるぞ」と心に決めていたのですが、今回その悲願を達成することができました。また、思い返してみれば、昨年ほかの参加者が多くの企業の方々とお話ししているのをうらやましく眺めていた記憶があります。しかし、今回は私自身が東京エレクトロンの方々とお話ができ、嬉しいお言葉をいただきました。そこで、私も昨年うらやましく思っていた方々のようになれたのかなと自分の成長を改めて実感しています。

最後に、このたび研究を支えてくださり指導して下さった、黒田先生を始めとする多くの先生方、先輩方、またこのような機会をくださった Step-QI 事務局の皆さまに、この場をお借りして深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2019年3月11日  
電気情報物理工学科  
応用物理学コース 学部3年  
沼尾 直毅